

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年 6月 5日現在

機関番号:12101
研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2010 ~ 2012
課題番号:22560102
研究課題名(和文)ナノ切削金型を用いた微小転写加工の高機能色素増感太陽電池開発への応
用。    用
研究課題名(央文)Application of micro-transcription by using nano-cutting mold to development of high-functional dye-sensitized solar cell
研究代表者
山本 武幸    (YAMAMOTO Takeyuki)
茨城大学・工学部・技術職員
研究者番号:40396594

研究成果の概要(和文):本研究では、ナノ・マイクロ振動援用切削と陽極酸化加工を組合せ利 用して、微小表面構造転写用金型を製作した.製作した微小表面構造転写用金型を用い、導電 性透明樹脂電極表面に、金型に施された微小凹凸構造を転写加工した.そして、製造した微小 凹凸構造付き導電性透明樹脂電極の性能を評価するため、色素増感太陽電池に適用した.発電 性能評価実験の結果、試作した色素増感太陽電池における発電効率の向上が確認された.

研究成果の概要(英文): In the present study, mold for surface micro-textures transcription was fabricated by using the combination of the vibration assisted nano/micro-cutting and the anodic oxidation. Numerous surface micro-sructures were duplicated on a conductive transparent resin electrode surface by using fabricated micro-texture mold, and its performance was evaluated by applying it to the dye-sensitized solar cell. As a result, an improvement in the electric power generating efficiency was confirmed in the fabricated solar cell.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2010年度	1,500,000	450,000	1,950,000
2011年度	1,000,000	300,000	1,300,000
2012年度	900,000	270,000	1,170,000
年度			
年度			
総計	3,400,000	1,020,000	4,420,000

研究分野:ナノ・マイクロ加工

科研費の分科・細目:生産工学・加工学

キーワード:表面微細構造,切削,振動,透明電極,転写,色素増感太陽電池

## 1. 研究開始当初の背景

酸化チタンの光触媒作用は「本田・藤嶋効 果」とも呼ばれ、世界初の光による水の分解 を達成した.1991年には"湿式太陽電池" と呼ばれる新型の太陽電池としてグレッツ ェル教授らが提案した、酸化チタン粒子を用 いる色素増感型太陽電池の研究が始まった. 色素増感太陽電池は、シリコン半導体を用い ずに、半導体である酸化チタンの表面に色素 を沈着させることによって光を吸収させる 方法に基づいており、ヨウ素溶液を介した電 気化学的なセル構造を持つのが特徴である. 材料も安価であり、作製に従来のシリコン系 のような巨大設備を要さないため、低コスト の太陽電池として期待も大きい.

文献調査によると、色素増感太陽電池にお ける光エネルギーの最大変換効率は、11%程 度となっている.理論上の最高効率は33%と されているが、これは単一の光吸収色素を用 いた話であり、複数の色素をうまく組み合わ せれば、さらなる性能向上が見込まれる.長 期安定性に関しては、液漏れの観点から従来 のシリコン太陽電池にはまだ及ばないため、 今後の課題となっている.

色素増感太陽電池の発電効率は,導電性ガ ラスないし樹脂電極表面に塗布した酸化チ タンのナノ粒子(直径数十 nm)およびそれ に沈着した色素の形態や透明電極の光の透 過が発電効率を大きく左右し,そこでは電極 表面性状が重要な因子となる.しかしながら, 導電性透明電極の表面性状に対する検討は, 国内外を合わせみてもなされていない.

一方,表面微細構造の作製法として,ナノ インプリントへの期待が高まっている.それ は nm~µm の凹凸パターンが施されたモー ルドを用い,熱や光硬化性樹脂やガラス等に パターン転写する技術である.現在,マイク ロレンズアレイなどの大量生産にも利用さ れつつあり,実用が拡大している.インプリ ント加工は,MEMS プロセスに比べ,大掛 かりな設備を必要とせず,低コストである利 点をもち,樹脂等の材料の表面微細加工には 好適な手法である.

色素増感太陽電池の透明樹脂電極表面に おける反射防止等の問題解消にナノインプ リント加工(ロール・トゥ・ロールに展開す れば極めて有効)を利用することは,将来的 な高機能色素増感太陽電池の量産化におい て,大変有意義である.

## 2. 研究の目的

本研究は、 色素増感太陽電池に利用される、 導電性透明樹脂電極表面に対し、微細熱転写 加工によるナノ(サブミクロン)ないしミク ロンオーダの表面凹凸構造を創成し,太陽光 の散乱ないし反射低減および酸化チタン膜 の吸着力と吸着量を増大させることなどに よって,太陽光発電効率の向上を目指す.そ のために、 導電性透明樹脂電極の転写加工用 モールドをナノ・マイクロ切削と陽極酸化加 工によって製造し,本研究にて開発予定の転 写加工装置を用い、導電性樹脂表面にナノ (サブミクロン) ないしミクロンオーダの表 面凹凸構造を転写加工する. そして, 得られ た表面微小凹凸構造付き透明電極を用いて 色素増感太陽電池を製作・評価し、平坦な透 明電極を用いた場合よりも高い発電効率を 実現させる.

## 研究の方法 以下に示す研究方法をとる.

- (1) 図1の微小切削装置概要と振動切削方式, 工具に示したように,FTS(ファスト・ ツール・サーボ)を利用して,切込み深 さ方向に工具を振動させる方法による, 高周波微小振動切削を利用して,数百nm ~数µm 規模の微小凹凸が数µm 周期で 無数に並ぶ表面構造をアルミニウム板上 に製造する.微小硬度計に用いられてい る単結晶ダイヤモンド圧子を切削工具と して利用する.
- (2) (1)によって無数の周期的な微小凹凸が 設けられたアルミニウム板に対し,図2 の概要に示した方法によって陽極酸化加 工を施し、アルマイト処理による硬化と 耐摩耗性向上をもたらすとともに、約 500 nm 規模の無数のオレンジピール構 造を設け、複雑な微小表面構造を有する 転写加工用金型を製造する.
- (3) 図3に示したように、導電性透明樹脂電 極用の両面同時熱転写加工装置を製作し、 上述の(2)より得られたモールドを用い て実転写加工を施し、透明電極表面に無





数のナノ(サブミクロン)およびミクロ ンオーダの表面凹凸を有する導電性透明 樹脂電極を製造する.

- (4) (3)によって得られたナノ(サブミクロン)およびミクロンオーダの表面凹凸をもつ導電性透明樹脂電極を利用して,色素増感太陽電池を製作し,表面未加工の導電性透明樹脂電極を用いた場合と性能を比較する.そして,開発した色素増感太陽電池の高性能性を明らかにする.
- 4. 研究成果
- (1) 微小振動切削による表面微小構造創成

ー例として,工具の陵をすくい面とし,平 均押込み深さ9μm,切削速度40 mm/s,振動 周波数900 Hz,振幅6μm,送り44μm/revの 条件で工具を押込み深さ方向に振動させなが ら切削した結果について述べる.

図4に、微小振動切削により得られた表面 微小構造のレーザ顕微鏡観察結果を示す.こ の結果より、逆三角錐形の無数の圧痕から成 り立っているような切削溝の形成が確認でき る.各溝は、幅44 µm、最大高低差は約24 µm になっている.最大切込み深さ(振動による 伸び6 µm 時)15 µm に対し、塑性盛上りの影 響が大きいことがわかる.これは、溝周囲に 形成された塑性盛上りが互いに干渉し合って 盛上り高さを増大させたことによる.こうい った現象は、実表面積を増大させる効果をも たらす.

(2) 陽極酸化による硬化とナノ構造創成 図4に示した微小構造付きアルミニウム板 を陽極酸化して得られた,転写用金型表面の レーザ顕微鏡観察結果を図5に示す.

図5からも、図4でみられたマイクロ表面 凹凸構造が確認できる.陽極酸化前の工作物 表面は金属光沢が観察できたのに対し、陽極 酸化後は白く曇ったことから、アルマイト処 理され最表面はAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>に変質・硬化されてい ることが確認されている.これは、金型の耐 久性向上につながるものである.また、ナノ 凹凸構造(500nm程度の規模のオレンジピー ル構造)の創成も確認され、このようなナノ 凹凸構造による表面積の増大も明らかにな っている.

(3) 導電性透明樹脂電極への表面構造転写

図6は、図5に示した微小凹凸構造付き金型によって、透明樹脂電極の導電面に微小テクスチャを転写した後の CCD 顕微鏡による表面観察結果を示している.

転写された各微小構造の形状・寸法に多少 のばらつきはみられるものの,ほぼ的確に金 型の構造が転写されている.離型剤不使用で あったものの,離型は円滑であった.



図 4 微小振動切削後のアルミニウム板表面 のレーザ顕微鏡像



図 5 陽極酸化後の微小凹凸付きAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜表 面のレーザ顕微鏡像



図 6 製作した微小凹凸構造付き金型により 転写加工された導電性透明樹脂電極表 面の顕微鏡写真

(4) 色素増感太陽電池の製作と性能評価

図7に, 色素増感太陽電池の概要および試 作品の外観を示す.

本研究では、安価かつ環境に配慮した材料 として、ハイビスカスのエタノール抽出色素、 イソジン電解液を要素の一部として利用した. また、厚さ 200 µm の透明樹脂電極の電極面 (入光面の反対)に、厚さ15 µm 程度の酸化 チタンナノ粒子(粒径 50 nm 程度)の層を塗 布したものを色素増感太陽電池の陽極に用い、 対極はアルミ板とした.表面微小凹凸構造を 導入したものと、しないものを用い、電流計、 電圧計、可変抵抗、蛍光灯などから構成され



図7 色素増感太陽電池の概略および外観

表 1 色素増感太陽電池の発電効率における 透明電極表面への微小凹凸付与の効果

	Max power P	Efficiency //
W/o texture	$0.0366 \text{ uW/mm}^2$	0.748 %
With texture	0.0415 µW/mm <sup>2</sup>	0.848 %



図 8 改良のため製造したナノ(サブミクロン)オーダ凹凸構造を有する金型表面のレーザ顕微鏡像

る評価システムによってI-V特性を測定し、その近似曲線式から、最大出力 $P_{max}$ 、さらには変換効率 $\mu$ などを算出し、発電性能を比較評価した.

出力の処理結果の一部を表1に示す.出力 からみると構成要素は適切とはいえないため, 変換効率はかなり低くなっているものの,微 小テクスチャを導入した透明樹脂電極を用い た色素増感太陽電池の方が最大出力電力およ び変換効率ともに高くなっていることがわか る.これは,透明電極の光入射面において微 小凹凸によって光の分散が起こり,酸化チタ ン電極に効率よく光が入射することによるも のと考えられる.

よって、微小凹凸構造を透明電極表面へ導 入することが色素増感太陽電池の発電効率の 向上につながるという事実が判明した.

また,表面凹凸構造のさらなる微小化は, 色素増感太陽電池のさらなる発電効率の向上 につながると考えられるため,その試みを継 続している.そして,図8に示すように,平 均高低差<1μm,周期3μmの表面微小構造 金型の製造も達成しており,これまで同様に 色素増感太陽電池製作やその性能評価に展開 していく. 〔研究成果のまとめ〕

機械加工による表面微小テクスチャ製造 用金型の開発およびその応用を目指し,μm オーダの微小振動を工作物表面に対して垂 直に付加しつつ切削することにより,無数の 微小凹凸構造を有する表面の創成を試み,さ らにそれを陽極酸化することにより金型を 製造した.また,その金型によって透明樹脂 電極へ表面テクスチャを転写し,色素増感太 陽電池に利用し,その発電効率を評価した. その結果,数+μm 規模の三次元構造を無数 に有する金型の転写による表面微細構造付 き透明電極を用いた色素増感太陽電池にお ける発電効率の向上がみられた.

さらに,発電効率向上により有利とされる, より微細な表面構造を有す金型製作を目指 し,平均高低差<1 µm,周期3 µmの表面微 小構造金型の製造に成功し,色素増感太陽電 池のさらなる性能向上に展開しつつある.

5. 主な発表論文等

- 〔雑誌論文〕(計8件)
- W. Hang, <u>L. Zhou</u>, <u>J. Shimizu</u>, J. Yuan, 『A robust procedure of data analysis for micro/nano indentation』, Precision Engineering, Vol.37, pp.408-414, 2013.1, 查 読 有 , 10 1016/i precisionang 2012 11 003
  - 10.1016/j.precisioneng.2012.11.003
- ② J. Shimizu, L. Zhou, T. Yamamoto, 『Molecular Dynamics Simulation of Energy Dissipation Process in Atomic-scale Stick-slip Phenomenon』, Tribology Online, Vol.8, pp.38-43, 2013.1, 査読有, 10.2474/trol.8.38
- ③ K. Uezaki, J. Shimizu, L. Zhou, T. Onuki, H. Ojima, 『Molecular Dynamics Simulation of Metal Cutting with Local Hydrostatic Pressure Field Formation』, Key Engineering Materials, Vols.523-524, pp.167-172, 2012, 査読有, 10.4028/www.scientific.net/KEM.523-52 4.167
- ④ W. Hang, <u>L. Zhou</u>, <u>J. Shimizu</u>, <u>T.</u> Yamamoto, J. Yuan, Study on micro/nano-indentation of typical soft-brittle materials], Key Engineering Vols.523-524, Materials. pp.7-12, 2012.11, 杳 読 有 10.4028/www.scientific.net/KEM.523-52 4.7
- ⑤ J. Shimizu, G. Kobayashi, N. Hasegawa, T. Yamamoto, H. Ojima, T. Onuki, L. Zhou, 『Influence of Surface Micro Texture on Photocatalitic Function of Titanium Dioxide Film』, Materials Science Forum, Vols.706-709, pp.2646-2651, 2012.1, 查読有,

10.4028/www.scientific.net/MSF.706-70 9.2646

- 6 W. Ohsone, J. Shimizu, L. Zhou, H. Ojima, T. Onuki, T. Yamamoto, H. [ Mold Fabricated Huang, bv for Nanoimprint Nanoscratching Lithography  ${\tt J}\,$  , Advanced Materials Research, Vols.126-128, pp.843-848, 2010.9.杳 読 有 10.4028/www.scientific.net/AMR.126-12 8.843
- ⑦ J. Shimizu, L. Zhou, K. Takamori, H. Ojima, T. Yamamoto, H. Huang, 『Enhancement of Photocatalytic Reaction of Titanium Dioxide Film by Surface Texturing』, Materials Science Forum, Vols.654-656, pp.1784-1787, 2010.8, 查読有, 10.4028/www.scientific.net/MSF.654-65 6.1784
- ⑧ J. Shimizu, L. Zhou, T. Yamamoto, H. Huang, 『 Molecular Dynamics Simulation of Rubbing Phenomena in Ultra-Precision Abrasive Machining』, Key Engineering Materials, Vol.443, pp.417-422, 2010.6, 査 読 有, 10.4028/www.scientific.net/KEM.443.41 7

〔学会発表〕(計9件)

- ① <u>清水</u> 淳,『微小テクスチャ金型の開発 とその応用(第2報)-振動切削の高周 波化によるテクスチャの微小化-』,精 密工学会春季大会,2013.3.13,東京工業 大学(大岡山)
- ② <u>清水</u> 淳, 『原子スケールのスティック スリップ現象を伴う摩擦におけるエネル ギー散逸過程の分子動力学解析』,日本 機械学会第4回マイクロ・ナノ工学シン ポジウム,2012.10.24,北九州国際会議 場
- ③ 山本武幸,『微小テクスチャ金型の開発 とその応用-振動切削による金型製造と 透明電極への適用-』,精密工学会秋季 大会,2012.9.14,九州工業大学(戸畑)
- ④ <u>清水</u> 淳,『掘起しを利用した微小テクスチャ加工に関する研究』,日本トライボロジー学会トライボロジー会議,2012.5.16,国立オリンピック記念青少年総合センター
- ⑤ J. Shimizu, 『Nanomold Fabrication by Scratching and Its Application to Nanoimprint Lithography』, 6th Int'l Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century, 2011.11.9, 大宮ソニックシティ
- 6 <u>J. Shimizu</u>, [ Molecular Dynamics

Simulation of Energy Dissipation Process in Atomic-scale Stick-slip Phenomenon 』, Int'l Tribology Conference 2011, 2011.11.1, 広島国際 会議場

- ⑦ 山本武幸,『微小切削テクスチャによる 光触媒機能の向上に関する研究』,精密 工学会秋季大会,2011.9.21,金沢大学 (角間)
- (8) J. Shimizu, Electrodes with Micro Ploughing Patterns for MEMS Applications , International Tribology Congress (ASIATRIB 2010), 2010.12.7, Hyatt Regency Perth (Australia)
- 周 立波,『Wavelet変換によるSiウエハ
   評価に関する研究(第1報)』,砥粒加工
   学会学術講演会,2010.8.26,岡山大学工
   学部

〔その他〕

ホームページ

https://sites.google.com/site/nlabibarakiuni v/

6.研究組織
 (1)研究代表者
 山本 武幸(YAMAMOTO Takeyuki)
 茨城大学・工学部・技術職員
 研究者番号:40396594

(2)研究分担者
 周 立波(ZHOU Libo)
 茨城大学・工学部・教授
 研究者番号:90235705

清水 淳 (SHIMIZU Jun)茨城大学・工学部・教授研究者番号:40292479

小貫 哲平 (ONUKI Teppei) 茨城大学・工学部・准教授 研究者番号:70400447

尾嶌 裕隆(OJIMA Hirotaka)
 茨城大学・工学部・講師
 研究者番号:90375361